This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

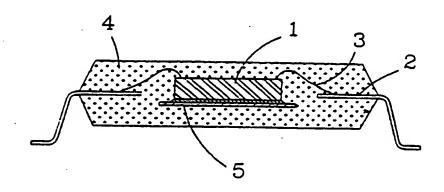
(19) 대한민국특허청(KR) (12) 등록특허공보(B1)

반도체 패키지의 제조방법			
심사관: 양희용			
서만규			
경기도 성남시 분당구 수내돔 55 !	美国的政트 132-1504		
대한민국			
허영목			
서울특별시 성동구 성수동 2가 28	0-8		
133-121			
대한민국			
아남반도체주식회사, 김규현			
1996년04월01일	(43) 공개일자	1997년11월07일	
10-1996-0009774	(65) 공개번호	馬1997-0072358	
	(24) 등록일자	1999년06월18일	
	(11) 등록번호	10-0220154	
	• • • = -		
	1996년04월01일 아남반도체주식회사, 김규현 대한민국 133-121 서울특별시 성동구 성수동 2가 28 청영욱 대한민국 경기도 성남시 분당구 수내동 55 : 서만규 심사관: 양희용	10-1996-0009774 (65) 공개번호 1996년04월01일 (43) 공개일자 아남반도체주식회사, 김규현 대한민국 133-121 서울특별시 성동구 성수동 2기 280-8 허영욱 대한민국 경기도 성남시 분당구 수내동 55 롯데아파트 132-1504 서만규 심사관: 양희용	(11) 등록번호 10-0220154 (24) 등록일자 1999년06월18일 10-1996-0009774 (65) 공개번호 특1997-0072358 1996년04월01일 (43) 공개일자 1997년11월07일 아남반도체주식회사, 김규현 대한민국 133-121 서울특별시 성동구 성수동 2가 280-8 청영목 대한민국 경기도 성당시 분당구 수내동 55 롯데아파트 132-1504 서만규 상사관: 양희용

00

본 발명은 반도체패키지의 제조방법 및 구조에 관한 것으로, 반도체칭의 저면을 외부로 노출시켜 회로동작시 발생되는 열방출의 효교를 극대화 하여 패키지의 수명을 연장시키고, 신뢰성을 향상 시림은 물론, 패키지의 몰당부 외측에 위치한 리드는 절단하고, 몰당부 내측에 위치한 리드는 그 저면을 외부로 노출시켜 마더보드에 실장시 리드의 저면에서 신호전달을 하도록 함으로서 실장면적을 최소화 할 수 있는 반도체패키지이다.

대표도



영세서

[발명의 명칭]

반도체패키지의 제조방법

[도면의 간단한 실명]

제 1 도는 일반적인 반도체패키지의 구조를 보인 단면도

제 2 도는 본 발명에 적용되는 리드프레임을 도시한 평면도

제 3a 도 내지 제 3e 도는 본 발명의 제조 공정도

제 48 도 내지 제 4d 도는 본 발명의 실시예에 의한 제조 공정도

제 5 도는 본 발명에 의한 반도체패키지의 저연도

제 6 도는 본 발명의 리드를 도시한 확대도

• 도면의 주요부분에 대한 부효의 설명

10 : 반도체천

20 : 리드프레임

21 : 리드

30: 와이어

41 : 액상봉지재

42 : 컴피운드

[발명의 상세한 설명]

본 발명은 반도체패키지의 제조방법에 관한 것으로, 더욱 상세히게는 반도체칭의 저면을 외부로 노출시켜 회로동작시 말생되는 열방출의 효과 로 그네고 한 리드는 그 저면을 외부로 노출시켜 마더보드에 실장시 리드의 저면에서 신호전달을 하도록 함으로서 실장면적을 최소화 할 수 있는 반도체패 크지의 제조방법에 관한것이다. 일반적으로 반도체패키지는 제 1 도에 도시된 바와 같이, 리드프레임의 침탐재판(2a)상에 에푹시 어도하시므(E 기시크 제고등등의 도모하여 반도체칭(1)을 접착시키고, 반도체칭(1)상의 함패도와 리드프레임의 리드(2)를 와이어(3)로 본당한 후, 컴파운드(4) 로 용당하여 반도체패키지를 제조하였다. 그러나, 이러한 구조는 컴파운드(4) 외부로 리드(2)를 노출시켜 소정의 형태로 리드(2)를 절곡하여 입 출력 단자로 사용하있으므로, 외부로 노출된 리드(2)에 충격이 기해져 쉽게 변형되는 이유로 유지 관리가 어려우며 패키지의 크기를 크게 만드 는 요인이 되었다. 또한, 반도체침(1)을 리드프레임의 칭탈재판(2a)에 접착시킬때 에폭시 어드히시브를 사용하기 때문에 에폭시와 반도체침(1) ______ 의 인터페이스(Interface)부분에서 계면박리 및 크랙(Crack)을 발생시키는 요인이 되었던 것이다. 뿐만 아니라, 반도체침(1)이 컴파운드(4)의 내 부에 위치하기 때문에 열방출이 되지 않아 패키지의 수명을 단축시키는 동의 문제점이 있었던 것이다. 따라서, 본 발명은 이러한 문제점을 해소 하기 위하여 발명된 것으로, 침탑재판이 구비되지 않은 리드프레임으로 패키지를 제조함으로서 반도체침과 침탐체판과의 계면박리 및 불량을 방지하고, 패키지의 신뢰성을 향상 시킬수 있도록 된 반도체패키지 제조방법을 제공함에 그 목적이 있다. 이러한 본 발명의 목적을 달성하기 위 해서는 다수의 리드가 형성되고, 상기 다수의 리드 중앙부에는 침탕재판이 없는 리드프레임을 형성하는 단계와: 상기 리드프레임의 다수의 리드 중앙부에 반도체침을 위치시켜 와이어본당을 실시하는 단계와; 상기 와이어본당된 리드, 반도체침 및 와이어를 외부의 산화 및 부식으로 부터 보호하기 위하여 물덩하는 단계와; 상기 단계후에 물덩영역 외각에 위치한 리도를 절단하는 단계로 이루어 진 것을 특징으로하는 반도체패키지 의 제조방법에 의해 가능하다. 이하, 본 발명을 참무도면을 참조하여 상세히 설명하면 다음과 같다. 제 2 도는 본 발명에 사용되는 리드프레임을 도시한 평면도로서, 본 발명의 리드프레임(20)에는 반도체칭(10)이 부착되는 칭팅재판이 형성되어 있지 않은 것을 알 수 있다. 제 3a 도 내지 제 3e 도는 본 발명의 제조 공정을 나타낸 도면으로서, 제 3a 도는 칩탑재판이 없는 리드프레임(20)에 기존의 다이본당시 반도체침(10)이 위치 되는 부분, 즉 다수의 리드(21) 중앙부에 반도체찾(10)을 위치시킨 상태를 도시한 것이고, 제 3b 도는 이외같이 반도체침(10)이 다수의 리드(21) 의 중앙부에 위치된 상태에서 와이어(30) 본딩을 실시한 상태를 도시한 것이다. 이때, 상기 반도체칩(10)은 제 7 도에 도시된 바와 같이 히터를 력(H)의 상부에 인착되는데, 이 히터블럭(H)에는 배큠 홀(V : Vacuum Hole)이 형성되고, 상기 배큠 흫(V)로 공기를 빨아들여 반도체침(10)을 고 정 지지함으로서 와이어 본당 중에 반도체칩(10)이 흔들림을 방지하는 것이다.

이와 같이 리드프레임과 반도체칭이 와이어 본당되면, 상기 리드프레임(20)을 운반 및 취급시에는 상기 반도체칭과 리드프레임이 와이어 본당 에 의해 서로 연결되어 있으므로 반도체침(10)이 분리되지 않는 것이다. 제 3c 도와 제 3d 도는 와이어 본당된 리드프레임(20)에 몰당을 실시하 여 반도체침(10)을 외부의 산화 및 부석으로 부터 보호하는 것으로, 여기서는 액상 봉지재(41)를 사용하여 본딩한 상태를 도시한 것이다. 이때, 상기 맥상 봉지재(41)가 흘러 넘치는 것을 방지하기 위하여 몰딩영역에 미리 댐(411)을 형성한 후, 액상 봉지재(41)로 몰딩을 실시하면 액상 봉 지째(41)가 흘러 넘치는 것을 방지할 수 있다. 이와 같이 물딩을 실시한 다음에는 150℃ 이상의 고운에서 수시간 노출시켜 액상 봉지재(41)를 경 화시키고, 제 3e 도와 같이 물딩영역의 외부에 위치된 리드(21)를 절단하여 반도체패키지를 완성하는 것이다. 상기 제조 공정중 물딩을 심시함 때 액상 봉지재(41)를 사용하지 않고, 액폭시 몰드 컴파운드(42)를 사용하여 제 4a 도 내지 제 4d 도에 도시된 바와같이 울딩을 실시할 수 있는 바, 컴파운드(42)를 사용하여 몰딩을 실시할 경우에는 몰드공형이 필요하게 되고, 몰딩양역의 외곽으로 댐(411)을 형성할 필요는 없다. 이때에 도 몰드 컴피운드(42)로 몰딩공정과 경화공정을 거친 후, 몰딩영역의 외각으로 돌출된 리드(21)를 절단하는 것이다. 이와 같은 제조공정을 거쳐 완성된 반도체패키지는 제 5 도에 도시된 바와 같이 저면에 반도체침(10)과 다수의 리드(21)가 노출된 상태로 형성되는 것이로, 반도체침(10)의 저면이 외부로 직정 노출되기 때문에 열방출이 우수하며, 다이본딩 공정을 거치지 않음으로서 계면박리가 발생되지 않는 것이다. 또한, 이와 같 은 반도체패키지는 물당영역의 외각으로 위치되는 라드(21)가 없어 취급시 라드(21)가 튀거나, 손상되는 것을 방지할수 있으며, 패키지의 터미 널(입출력단자) 부분이 패키지의 밑면에서 이루어짐으로 마더보드에 실장시 그 크기를 최소화 할 수 있는 것이다. 또한, 상기 반도체패키지의 저 변에는 그라인드(Grind)을 실시하여 패키지의 저면에서 발생할 수 있는 플래쉬(Flash)를 제거할 수 있다. 즉, 물딩 후에 플래쉬(물도 찌거기)를 제거하는 플래쉬 제거단계를 추가할 수 있다. 또한, 제 6 도와 같이 본발명의 반도체패키지는 몸당영역 외각에 위치한 리드(21)를 젊단시 리드(2 1)의 절단을 용이하게 하기 위하여 절단되는 부위의 리드(21)에 노치(211 : Notch)를 형성할 수 있다. 이와 같은 제조방법에 의해 형성된 반도체 패키지의 구조는, 저면이 외부로 직접 노출되는 반도체칭(10)과, 상기 반도체칭(10)의 외측에 위치되고 몰딩영역을 벗어나지 않으며 저변이 외 부로 노출되어 저면에서 신호의 입출력이 이루어지는 다수의 리드(21)와, 상기 반도체침(10)과 리드(21)를 연결시켜주는 와이어와, 상기 반도체 합(10), 리드(21) 및 와이어(30)를 외부 환경으로부터 보호하기 위하여 율딩된 액상 봉지재(41) 또는 컴피운드(42)로 구성된 것이다.

여시서, 상기 액상 봉지재(41)로 몰당할 경우에는 액상 봉지재(41)가 홈러 넘치는 것을 방지하기 위하여 몰당영역의 외각으로 당(411)을 형성한다. 또한, 상기 물당된 액상 봉지재(41) 및 컴피운드(42)는 라드(21) 및 반도체침(10)의 상부로만 물당되는 것이며, 상기 반도체패키지의 저면에는 플래쉬(Flash)의 제거를 위해 그라인드(Grind)를 실시할 수 있다. 이와 같은 구성의 반도체패키지는 저면으로 반도체침과 다수의 리드가 직접 노출되므로 열방출이 우수하며 계면박리가 발생되지 않고, 몰당영역의 외각으로 위치되는 리드가 없어 취급시 리드가 휘거나, 손상되는 것을 방지할수 있으며, 패키지의 터미널(임출력단자) 부분이 패키지의 및면에서 이루어짐으로 마더보드에 실장시 그 크기를 최소화 할 수 있는 잇점이 있다.

(57) 청구의 범위

청구함 1.

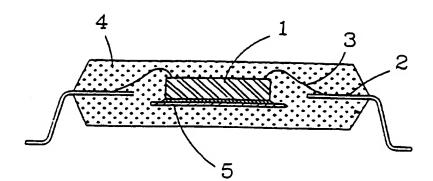
(정정) 다수의 리드가 형성되고, 이 다수의 리드 중앙부에는 침탑재판이 없는 리드프레임을 제공하는 단계와: 상기 리드프레임의 다수의 리드중앙부에 반도체칭을 위치시키되, 상기 반도체칭은 배큠 홈(VacuumHole)이 형성된 히터플럭에 안착시킨 후, 상기 배큠 홈로 공기를 빨아들여서 반도체칭을 지지 고정한 상태에서 와이어본당을 실시하는 단계와: 상기 와이어본당된 리드, 반도체칭 및 와이어를 외부의 산화 및 부식으로 부터 보호하기 위하여 몰당하는 단계와: 상기 단계후에 몰당영역 외각에 위치한 리드를 절단하는 단계를 포함하여 이루어진 것을 특징으로 하는. 반도체패커지의 제조방법.

청구함 2

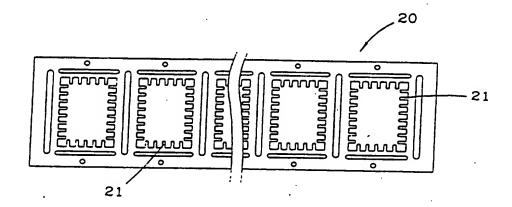
제 1 항에 있어서, 상기 물당하는 단계 후에는 반도체 패키지의 저면에 그리인드(Grind)를 설치하여 플래쉬(Flash)를 제거하는 플레쉬 제거 단계 ^를 더 포함하여서 이루어진 것을 욕장으로 하는 반도체패키지의 제조방법.

참구함 3.

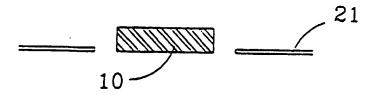
제 1 항에 있어서, 상기 몸당영역의 외각에 위치한 리드를 절단하는 단계는, 상기 리드의 절단되는 부위에 노치(Notch)를 형성하여 상기리드가 용이하게 절단되도록 한 것을 특징으로 하는 반도체패키지의 제조방법. 도면 도면 1



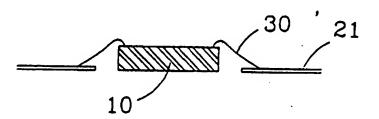
도면 2



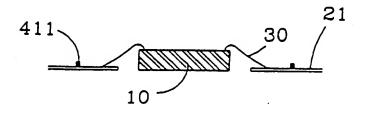
도면 3a



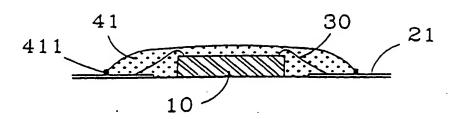
도면 3b -



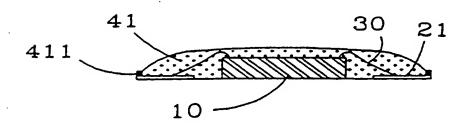
도면 3c ·



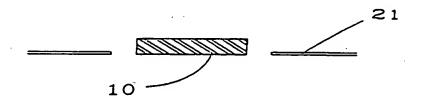




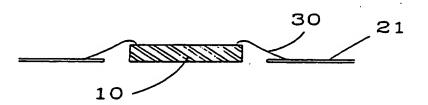
도면 3e



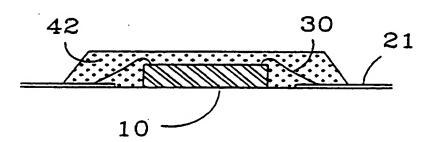
도면 4a



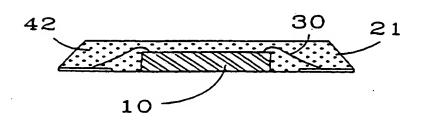
도면 4b



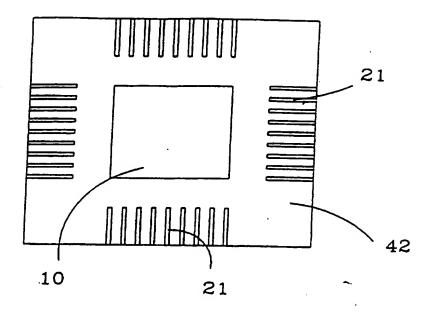
도면 4c



도면 4d



도면 5



도면 6

